

# VERRES CHALCOGENURES POUR L'OPTIQUE INTEGREE

Laboratoire de Physico-Chimie de la Matière Condensée  
Université Montpellier II

Direction : Annie Pradel, Caroline Vigreux

# Introduction

Matériaux vitreux contenant des éléments chalcogènes: S, Se, Te ainsi que des éléments des groupes IV et V: Ge, As, Sb

- indices de réfraction élevés
- photosensibilité
- faibles énergies des phonons
- domaine large de transmission du visible au lointain infrarouge, accordable selon la composition

## Guides d'onde optique



## Contrôle de l'environnement

- Capteur optochimique  
Détection gaz polluants

CNM

## Interférométrie spatiale

- Détection, étude des planètes extrasolaires

IMEP

## Amplification optique

- Matrices hôtes  
Dopage terres rares

LSP, IMEP

## Miniaturisation

## Couches minces

## LES COUCHES MINCES NON DOPÉES

### **Etat de l 'art**

- Nombreuses études sur les couches minces chalcogénures - sur la photosensibilité
- Peu d 'études sur la réalisation de composants optiques



### **Couches minces de qualité optique**

- adhérentes
- homogènes
- propriétés contrôlées et reproductibles
- épaisseurs importantes

# Les choix

- Méthode de dépôt

- Evaporation thermique

- » compositions non reproductibles
- » couches non adhérentes

- Pulvérisation cathodique



- Choix des matériaux

- » domaine large de transmission
- » stabilités chimique et thermique
- » indices de réfraction élevés
- » cibles commerciales

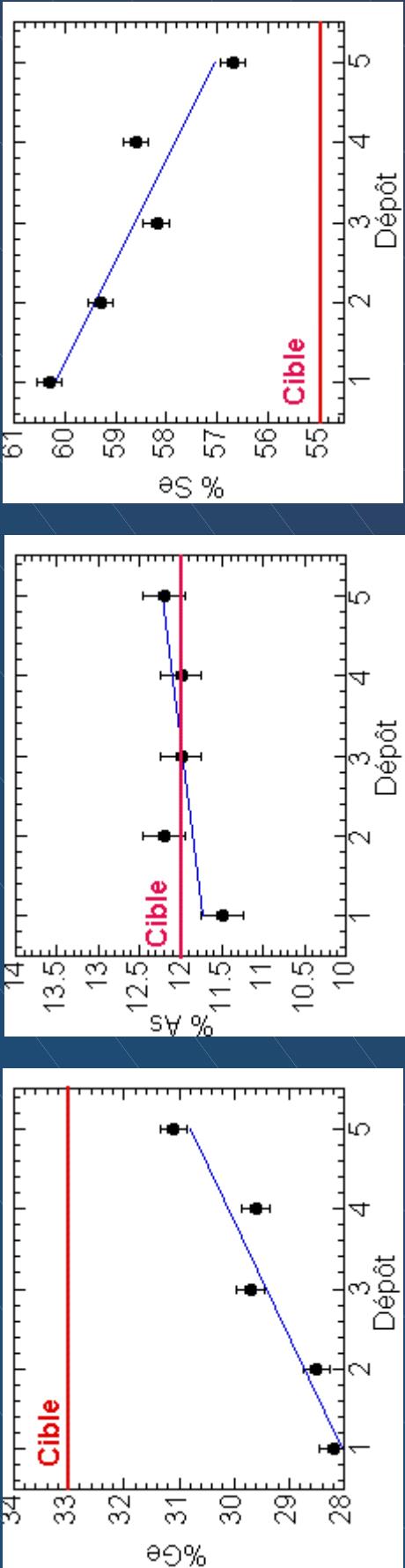
|  | $\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$ | $\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$ | $\text{As}_2\text{S}_3$ |
|--|--|--|-------------------------|
|  | 0,7-14                                       | 0,9-16                                       | 0,4-8                   |
|  | $T_g = 362^\circ\text{C}$                    | $278^\circ\text{C}$                          | $180^\circ\text{C}$     |
|  | $n_{1,55} = 2,55$                            | 2,63   | 2,44                    |

- Choix des paramètres de dépôt

- » puissance entre 20 et 30 W
- » pression de  $5 \times 10^{-2}$  mbar
- » polissage et décapage long des cibles avant chaque dépôt

# Les choix

## Série de 5 dépôts successifs $\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$



variation > 3% atomique (pulvérisation préférentielle)



variations trop importantes des propriétés optiques

- » Polissage de la cible avant chaque dépôt
- » Décapage long de la cible: 120 minutes

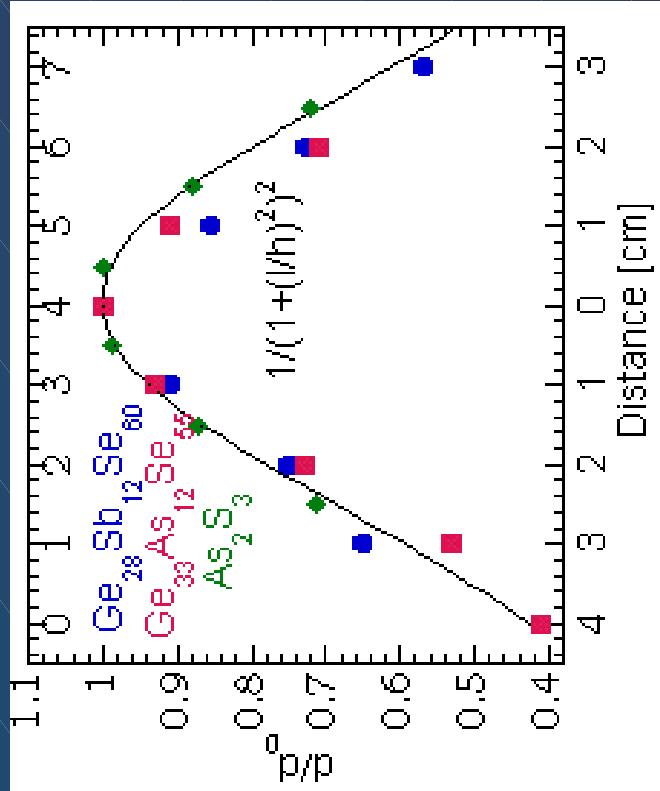
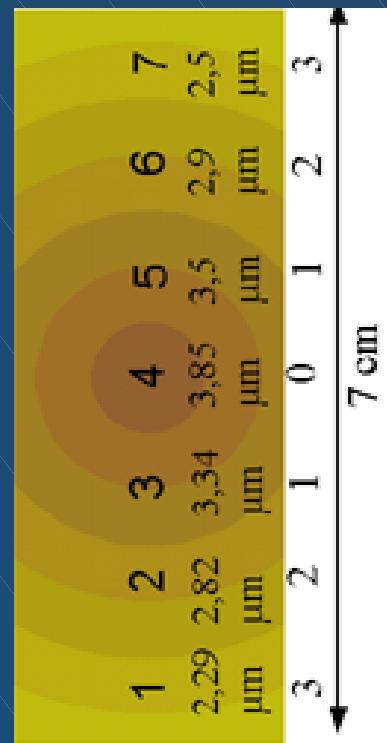


Reproductibilité  
variation < 1%

# Caractéristiques générales

- Epaisseur

- Variation de l'épaisseur: loi cosinusoïdale de Knudsen



- Couches d'épaisseur comprise entre 0,05-5 μm

- Adhérence

- Couches adhérentes au substrat (lame de microscope ou silicium)

# Caractéristiques morphologiques

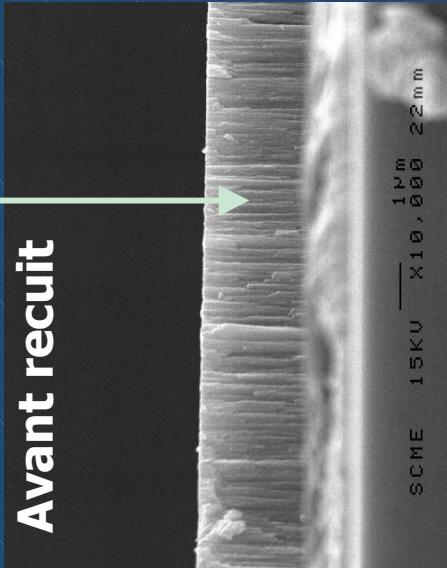
- Comparaison des différentes morphologies

$\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$  ( $T_g = 362^\circ\text{C}$ ),

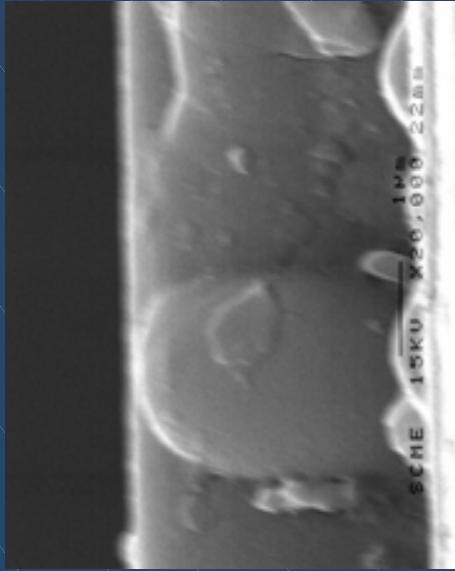
$\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$  ( $T_g = 278^\circ\text{C}$ )

Structure colonnaire

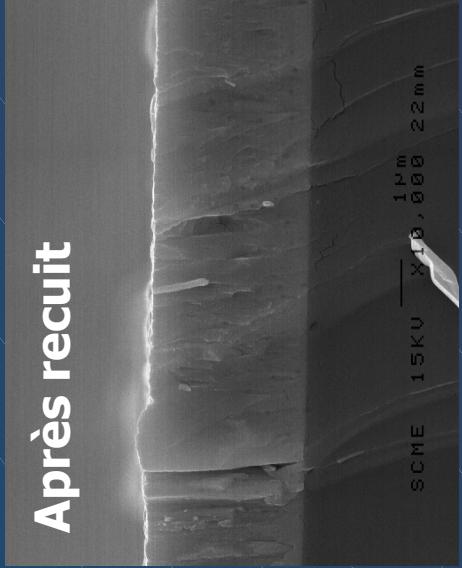
Avant recuit



$\text{As}_2\text{S}_3$   
Structure non colonnaire



Après recuit

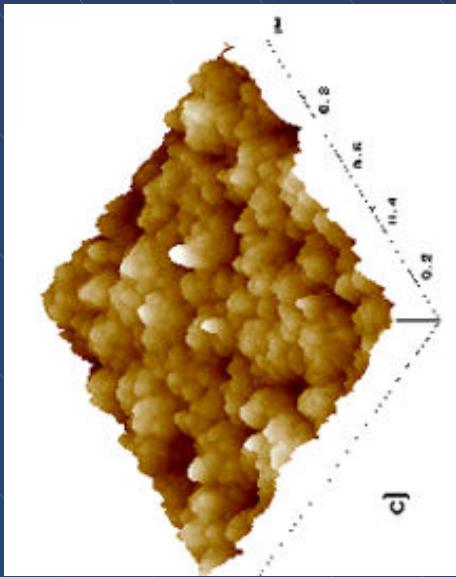


$T_g$  bas ( $180^\circ\text{C}$ ) : possibilité recuit pendant dépôt.

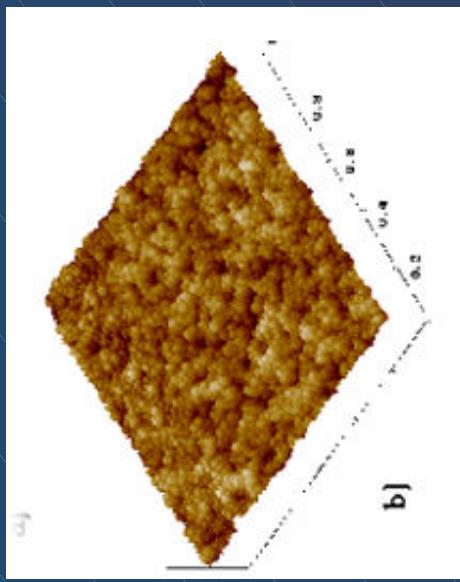
Recuit  $T_g+10$  : atténuation structure colonnaire

# Caractéristiques morphologiques

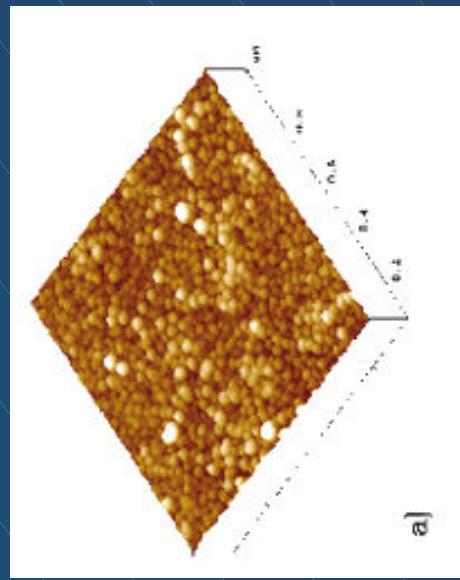
- Influence de l'épaisseur sur la morphologie
  - Couches  $\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$  de différentes épaisseurs



$e : 2,18 \mu\text{m}$ ,  
rugosité: 6,3 nm



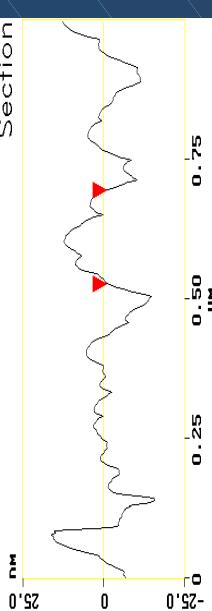
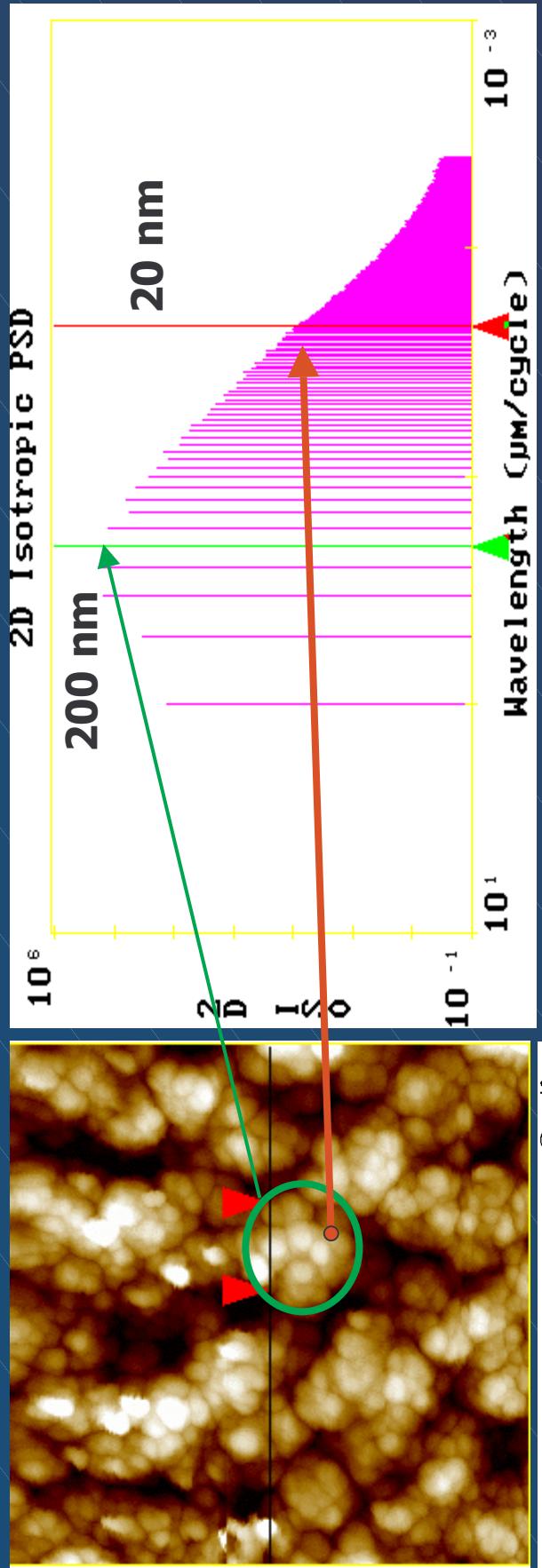
$e : 1,36 \mu\text{m}$ ,  
rugosité: 1,9 nm



$e : 0,2 \mu\text{m}$ ,  
rugosité: 1,1 nm

**e ↑ rugosité ↑**

# Caractéristiques morphologiques

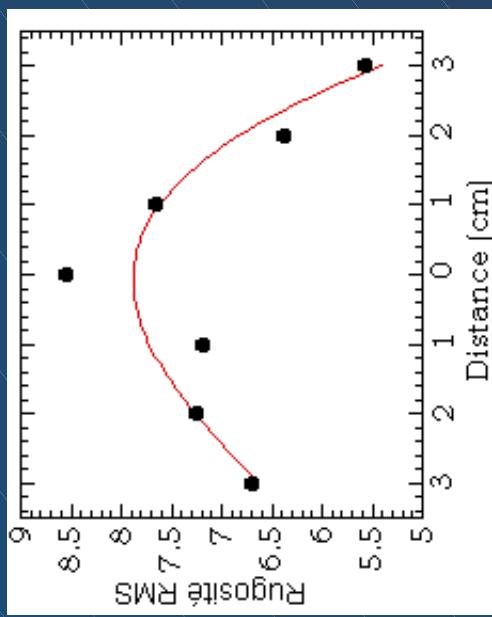
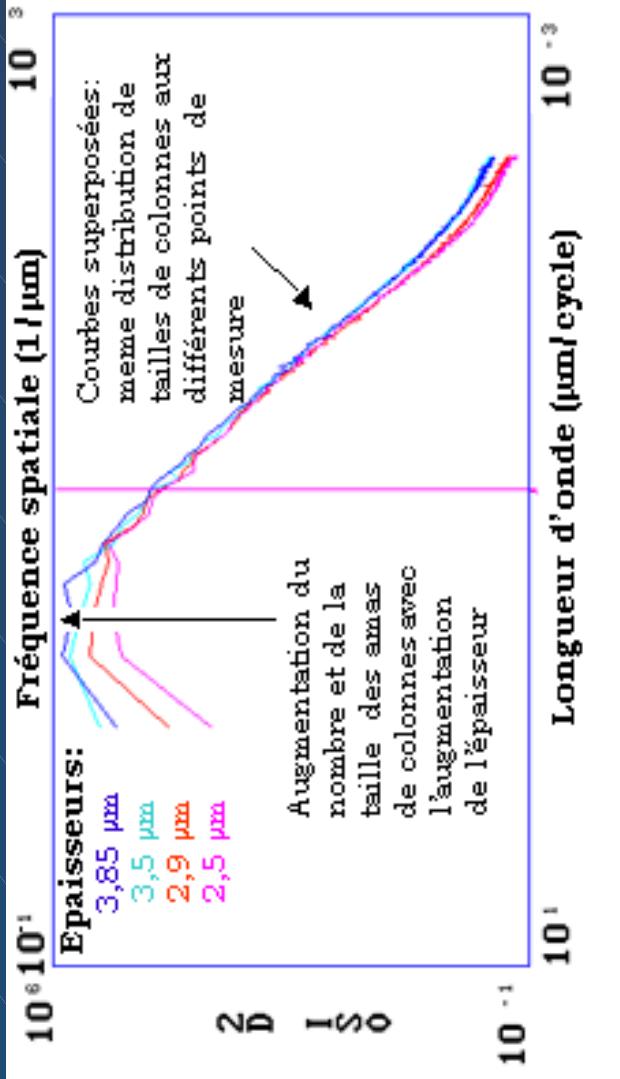
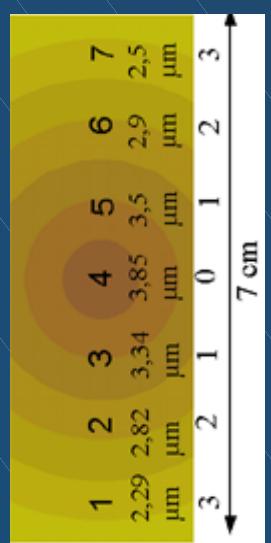


Colonnes de 20 nm de diamètre regroupement

Clusters de ~200 nm de diamètre

# Caractéristiques morphologiques

- Couche  $\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$  en différents points



Rugosité plus élevée au centre des couches, diminuant vers les extrémités

Colonnes: 20 nm diamètre

+

Amas de colonnes: 200-250 nm

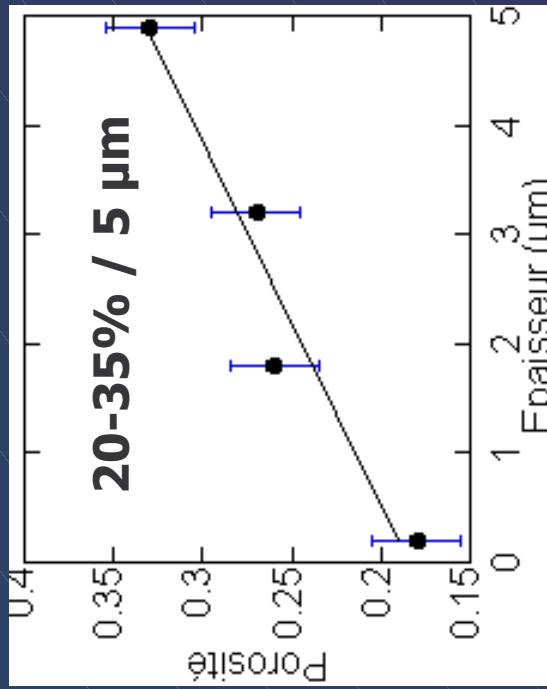
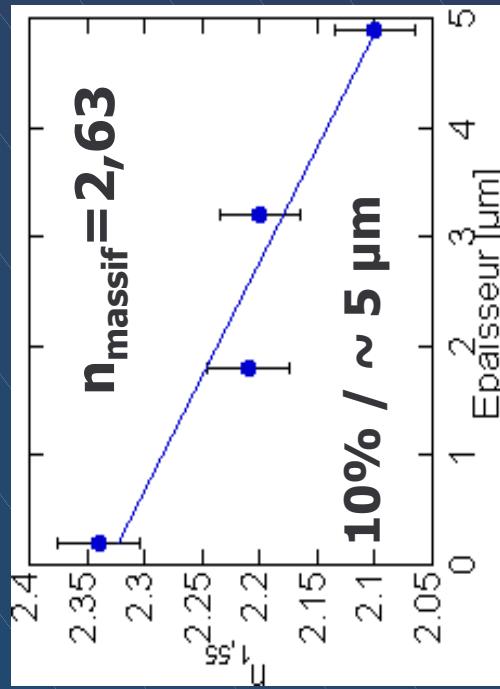
e ↑

regroupement colonnes

rugosité ↑

# Caractéristiques optiques

- Influence de la morphologie sur les caractéristiques optiques
  - Couches  $\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$  de différentes épaisseurs (0,2-5  $\mu\text{m}$ )



\*10-30% dans les couches optiques par évaporation thermique

**Indices de réfraction**  
estimés par ellipsométrie

**e ↗ espaces vides ↗ n ↗**

**Porosité des couches**  
estimée grâce au modèle Kinoshita-Nishihori

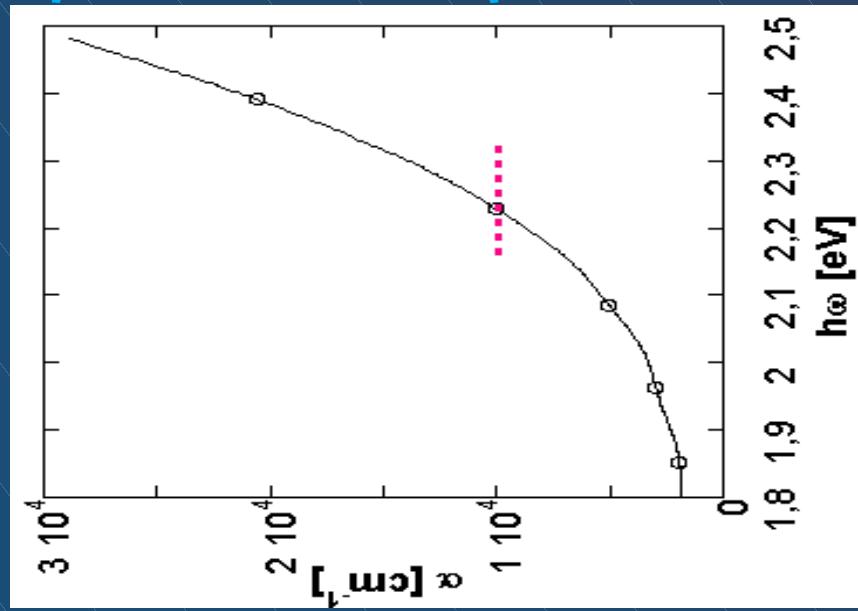
$$n = n_v p + n_s (1-p)$$

$n_v$  : indice des espaces vides  
 $n_s$  : indice du matériau  
 $p$  : porosité

**e ↗ porosité ↗**

# Caractéristiques optiques

Gap optique  $E_g$ , énergie Urbach  $E_e$  (désordre)  
estimés à partir des spectres d'absorption



$$\alpha(\omega) = \beta \frac{(\hbar\omega - E_g)^2}{\hbar\omega}$$

Tauc

$$\alpha(\omega) = \alpha_0 \exp\left(\frac{\hbar\omega}{E_e}\right)$$

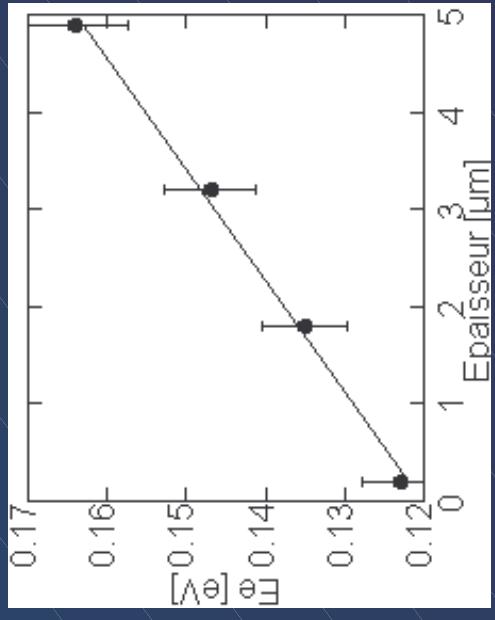
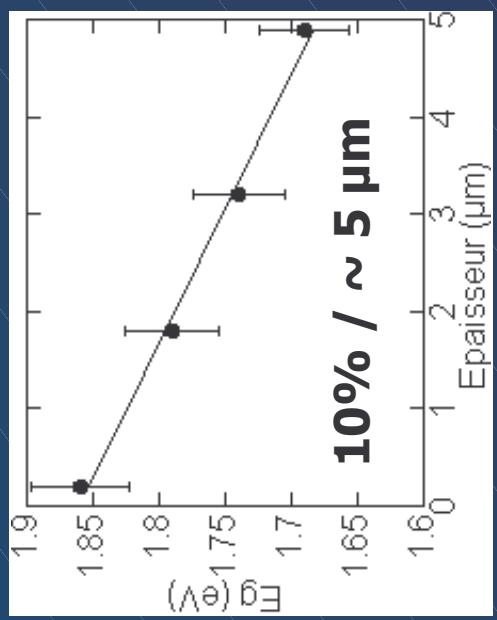
Urbach

évolution  
morphologie

$e \uparrow$

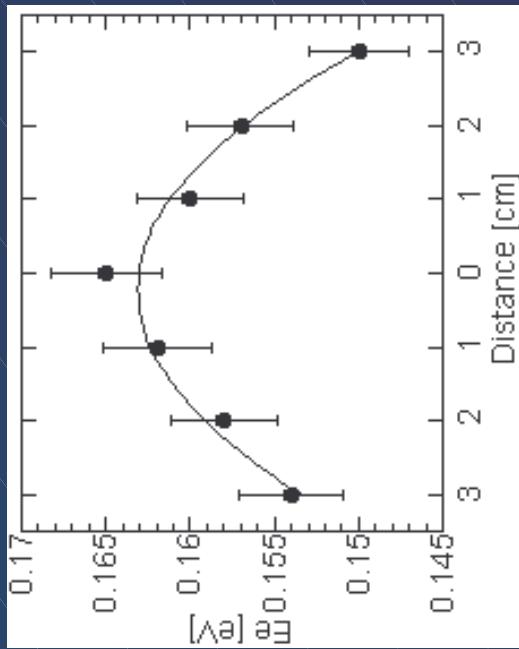
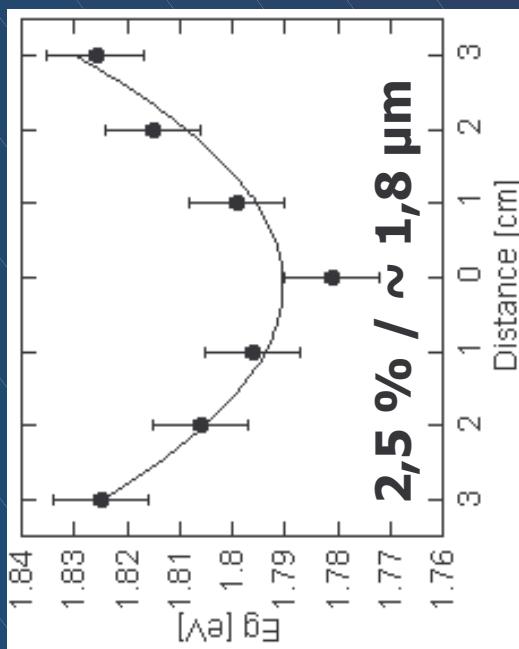
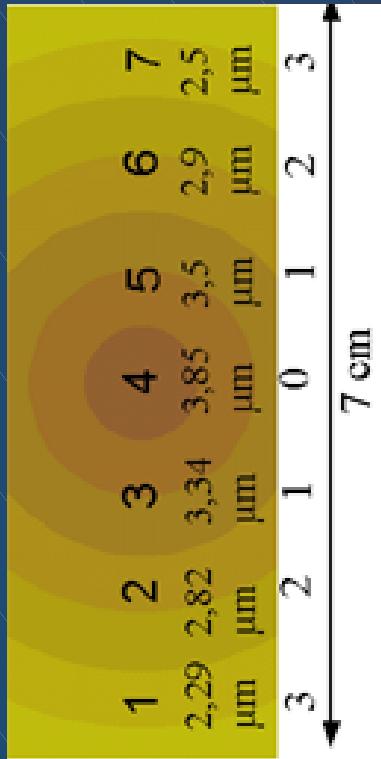
$E_e \uparrow$

12



# Caractéristiques optiques

- Couche  $\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$  en différents points



évolution morphologie

$e \nearrow E_e \nearrow E_g$

# Conclusion

Obtention de couches reproductibles (<1% de fluctuation de la composition chimique) après rectification des cibles

Couches d'épaisseur variable (entre 0,05 et 5 microns)  
adhérentes, mais inhomogènes en épaisseur  
- solution : substrat tournant

Structure colonnaire : dépendance propriétés (rugosité,  $E_g$ ,  $n$ ,  $E_e$ ) morphologie des couches mise en évidence



par l'étude en différents  
points d'une même couche

**e ↑ évolution regroupement de colonnes**

**taille amas ↑ rugosité**

**$E_e \uparrow$   $E_g \uparrow$   $n \uparrow$  espaces vides**

## **LES COUCHES MINCES DOPÉES**

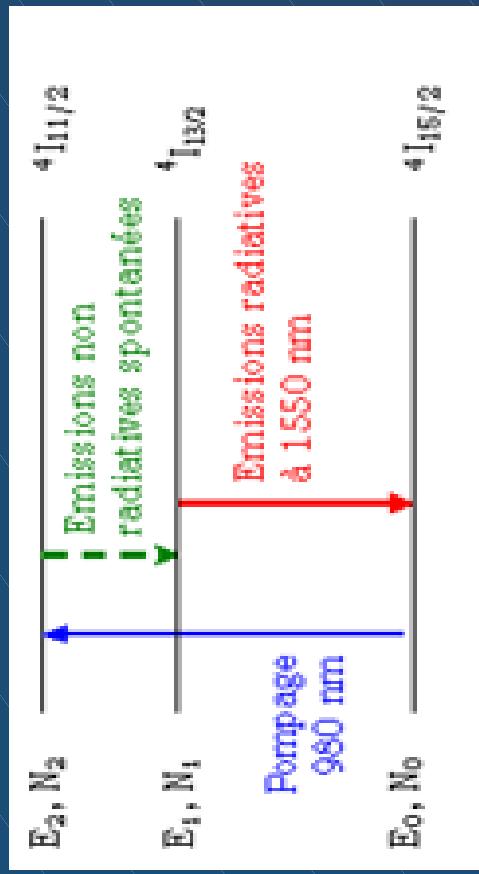
**Maîtrise de dépôts de couches minces chalcogénures non dopées**

**Amplification optique**

**Dopage par des ions de terres rares**

# Introduction

- Principe



## LES COUCHES MINCES DOPÉES

### Transitions

- » radiatives : émission
- » non radiatives : transfert de l'énergie à la matrice

- Etat de l'art
  - » verres massifs
  - » couches minces
    - » pulvérisation (Ramachandran)
    - » implantation ionique (Fick)
    - » ablation laser (Caricato)

Travail réalisé en étroite collaboration avec Adam Fuchs IMEP (thèse sous la direction de Jochen Fick)

- » durée de vie élevée :
- » amplification optique efficace
- » largeur bande d'émission :
- » amplification sur un large domaine

# Les choix

## • Choix des matériaux

$\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$

## • Choix de la technique de réalisation des cibles

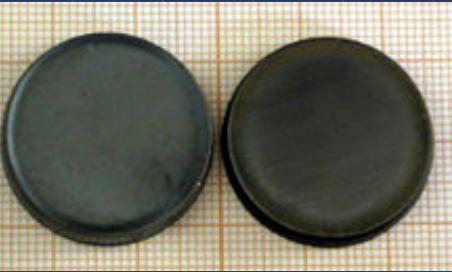
### • Cibles composites:

- collage de plots d 'érbium sur la surface de cibles commerciales (concentrations 2-22% en surface)
  - simplicité et rapidité
  - concentrations variables
  - non homogénéité de la distribution de l 'Er

### • Cibles multi-éléments :

- fusion-trempe d 'un mélange de poudres  $\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$  ( $\text{As}_2\text{S}_3$ ) +  $\text{Er}_2\text{S}_3$ 
  - synthèses longues
  - homogénéité de la distribution de l 'Er

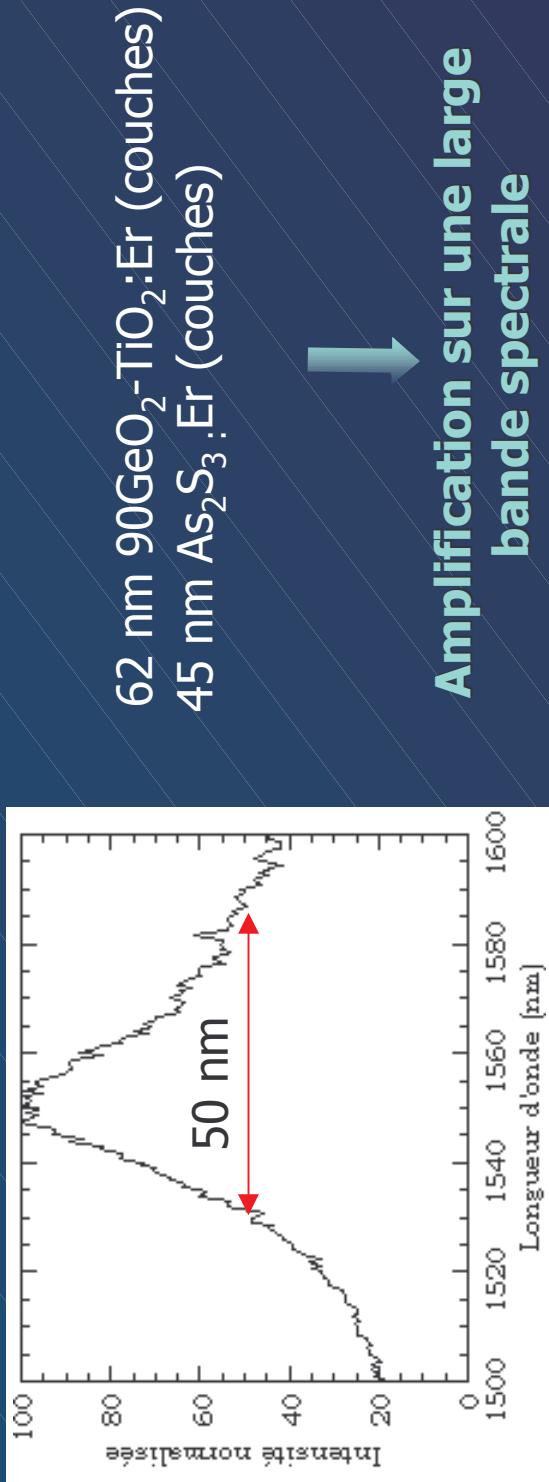
Cible commerciale  
diamètre 5 cm



Cibles synthétisées  
après découpe et  
polissage  
diamètre 2,5 cm

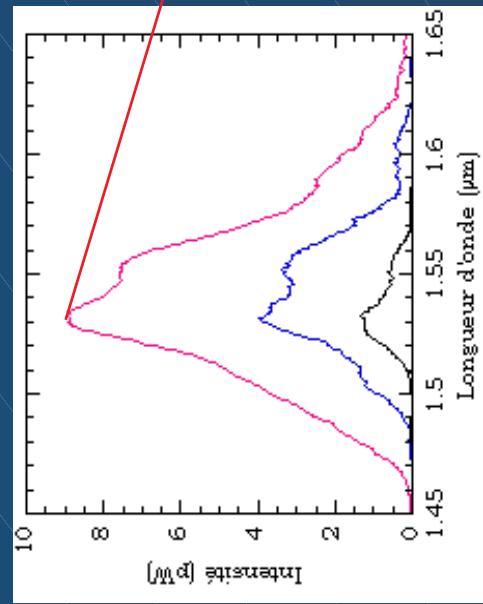
# Photoluminescence

- Photoluminescence mise en évidence dans toutes les couches minces (obtenues à partir des cibles composites ou multi-éléments) -  $\rightarrow \text{Er}^{3+}$
- Spectres caractéristiques des matrices vitreuses, allure comparable avec les spectres obtenus dans la littérature



# Photoluminescence

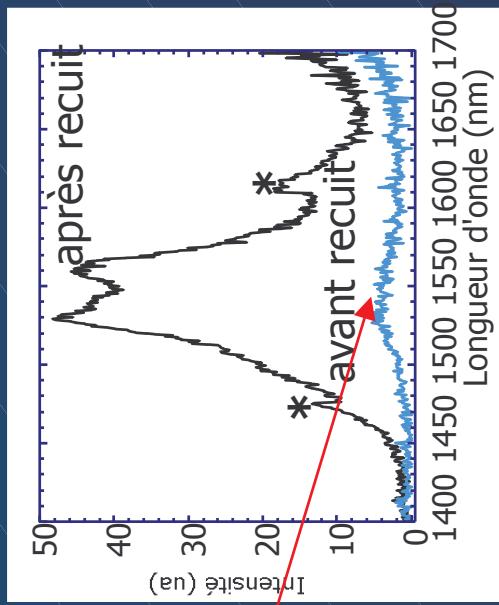
- Cibles composites



Intensité de la PL faible et non homogène

## Cibles multi-éléments

Intensité homogène de la PL sur toute la couche



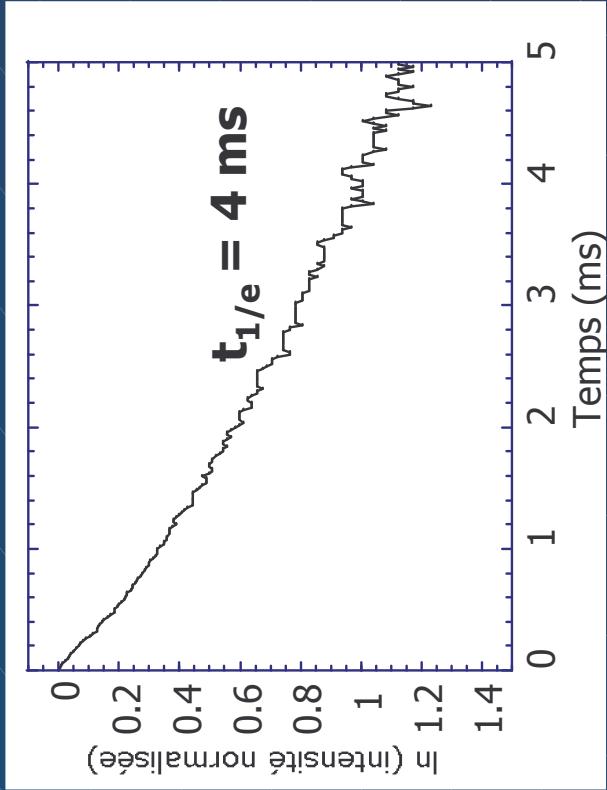
Un recuit post-dépôt homogénéise les couches et améliore la PL

(\*) Pics dus à l'appareillage

# Durée de vie

Estimée par des mesures du déclin de la photoluminescence

**As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>**



2,3 ms : 90GeO<sub>2</sub>-10TiO<sub>2</sub>:Er[1]  
2 ms : SiO<sub>2</sub>:Er[2]

2,3 ms : As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>:Er[3]

- 1-Martucci, A. *et al.*, J. Non-Cryst. Solids, 322, 2003, p. 295
- 2-Lu, F. *et al.* Thin Solid Films, 425, 2003, p.171
- 3-Fick, J. *et al.*, J. Non-Cryst. Solids, 272, 2000, p. 200

# Conclusion

## LES COUCHES MINCES DOPÉES

Dépôt de couches minces  $\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$  et  $\text{As}_2\text{S}_3$  dopées par des ions erbium à partir de deux types de cibles (composites et multéléments)

Photoluminescence obtenue dans toutes les couches minces  
-> erbium sous sa forme active  $\text{Er}^{3+}$

Répartition non homogène de l'erbium dans les couches obtenues à partir des cibles composites -> PL non homogène  
Problème résolu en recuisant les couches après dépôt

Premières valeurs des temps de vie de la PL encourageantes

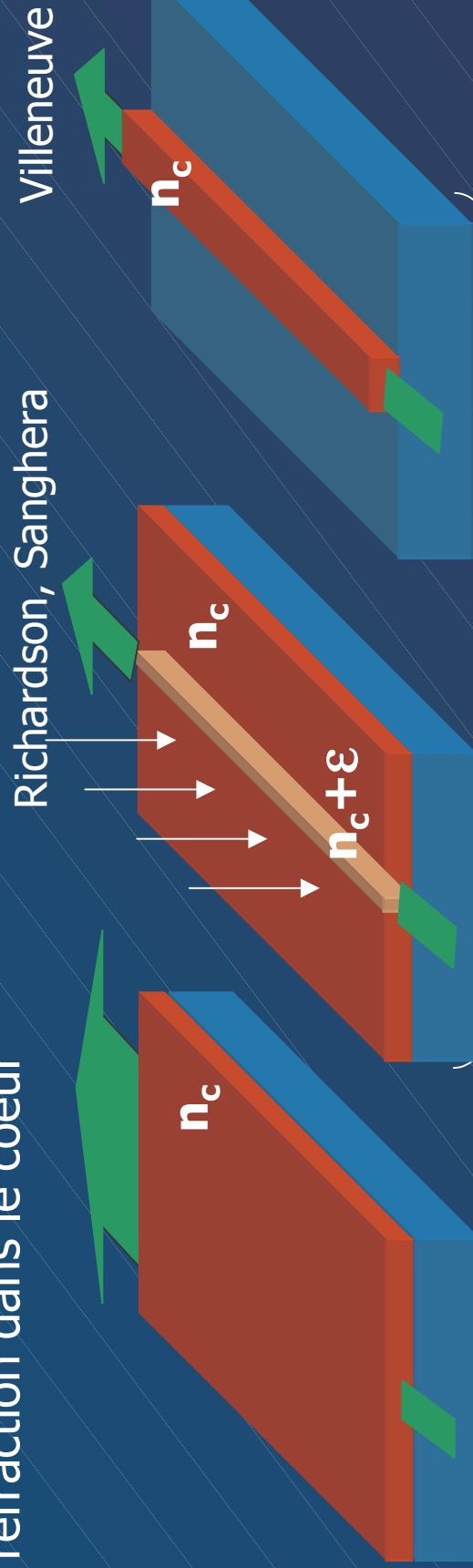
## **GUIDES D 'ONDE**

**Maîtrise dépôts de de  
couches minces chalcogénures**

**Réalisation et caractérisation de  
guides d 'onde chalcogénures**

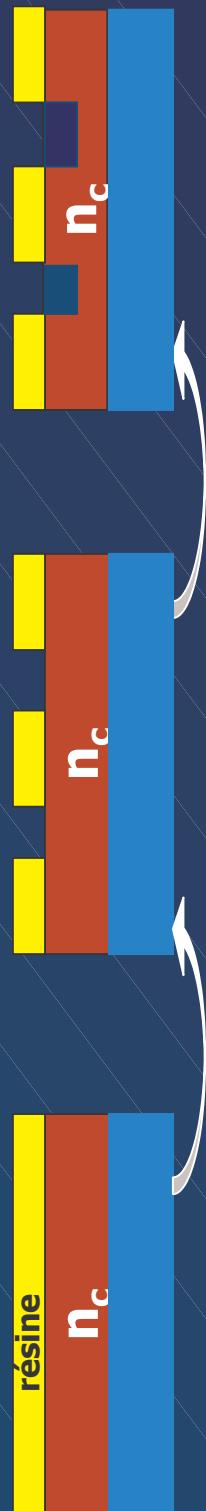
# Introduction

Guides d'onde : milieux matériels permettant un confinement de la lumière : confinement par la présence d'un maximum d'indice de réfraction dans le cœur



Pas de confinement latéral

Confinement latéral



procédé lithographique

Gravure : chimique  
plasma inerte  
plasma réactif

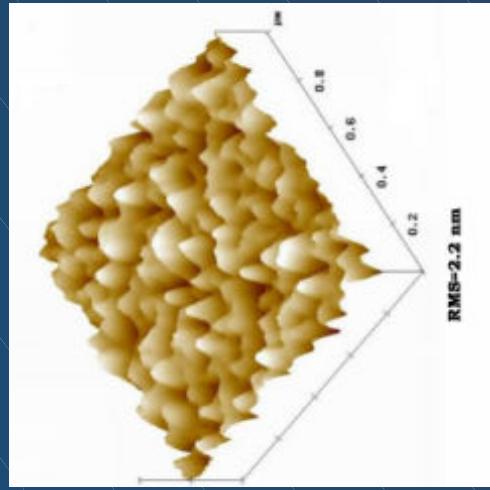
# Gravure chimique

## Immersion dans des solutions basiques

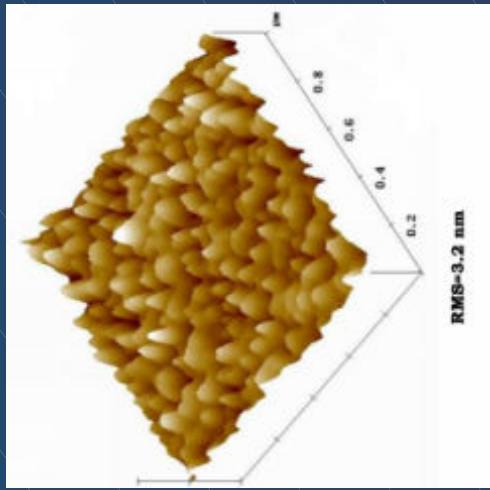


Solutions diluées (50 nm/min) :  
contrôle des profondeurs de gravure

Avant gravure



Après gravure  
de 250 nm



Rugosité : 2,2 nm

Rugosité quasi constante quelle que soit la profondeur de gravure

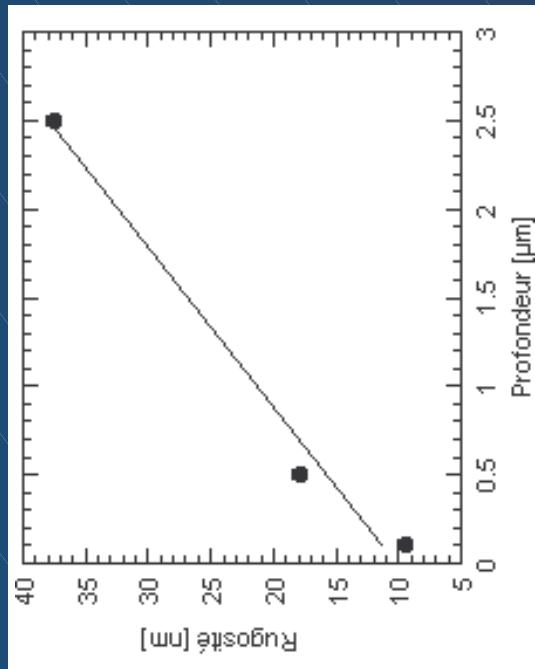
Rugosité : 3,2 nm

- Rapide, facile à mettre en œuvre
- isotrope  
-> angle de 45°
- perte de résolution pour des profondeurs élevées

# Gravure physique

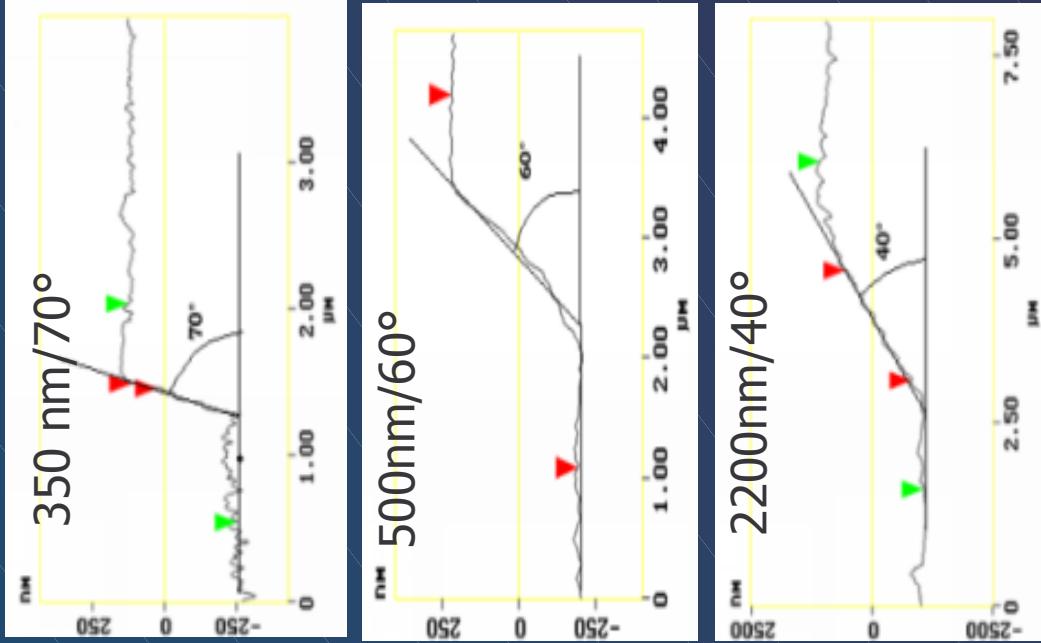
- Plasma argon

$5 \times 10^{-2}$  mbar/10 W => 10 nm/min.



Profondeur de gravure ↗ rugosité

- Rapide, anisotrope
- Manque de sélectivité
- => perte de résolution (masque gravé)



Profondeur de gravure ↗ angle

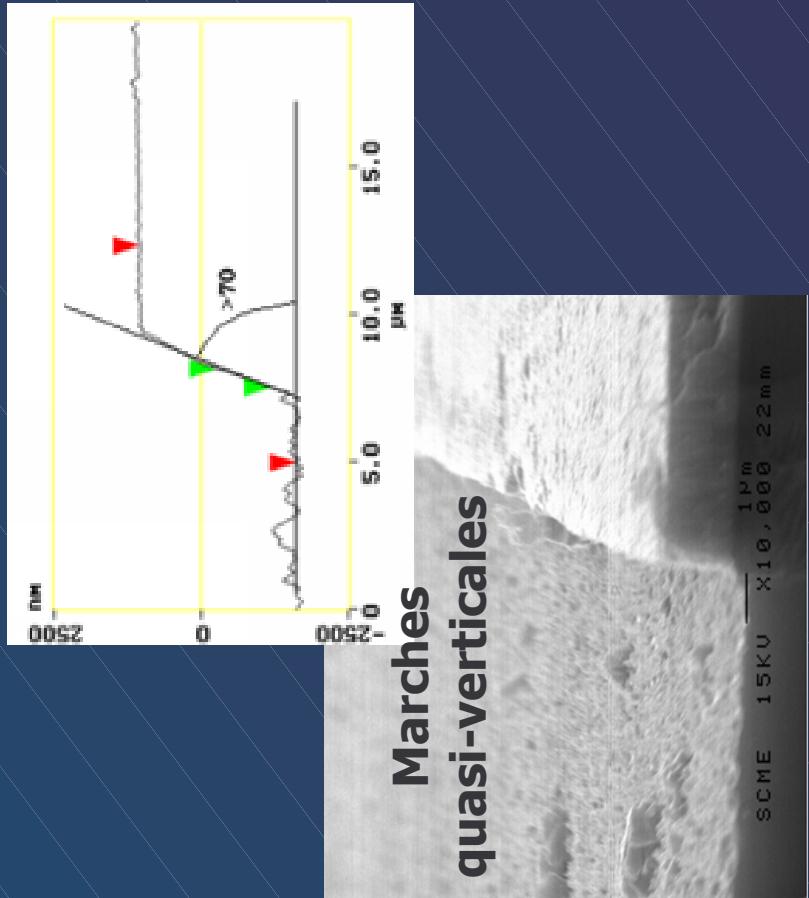
# Gravure physique

- Plasma réactif

| Gaz                             | Débit   | Vit de gravure |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Ar/H <sub>2</sub>               | 40/30   | 7 nm/min       |
| Ar/H <sub>2</sub>               | 20/53,8 | 7 nm/min       |
| Ar/ CF <sub>4</sub>             | 10/25,7 | 7 nm/min       |
| CF <sub>4</sub>                 | 25,7    | 14 nm/min      |
| CF <sub>4</sub> /O <sub>2</sub> | 25,7/2  | 200 nm/min     |

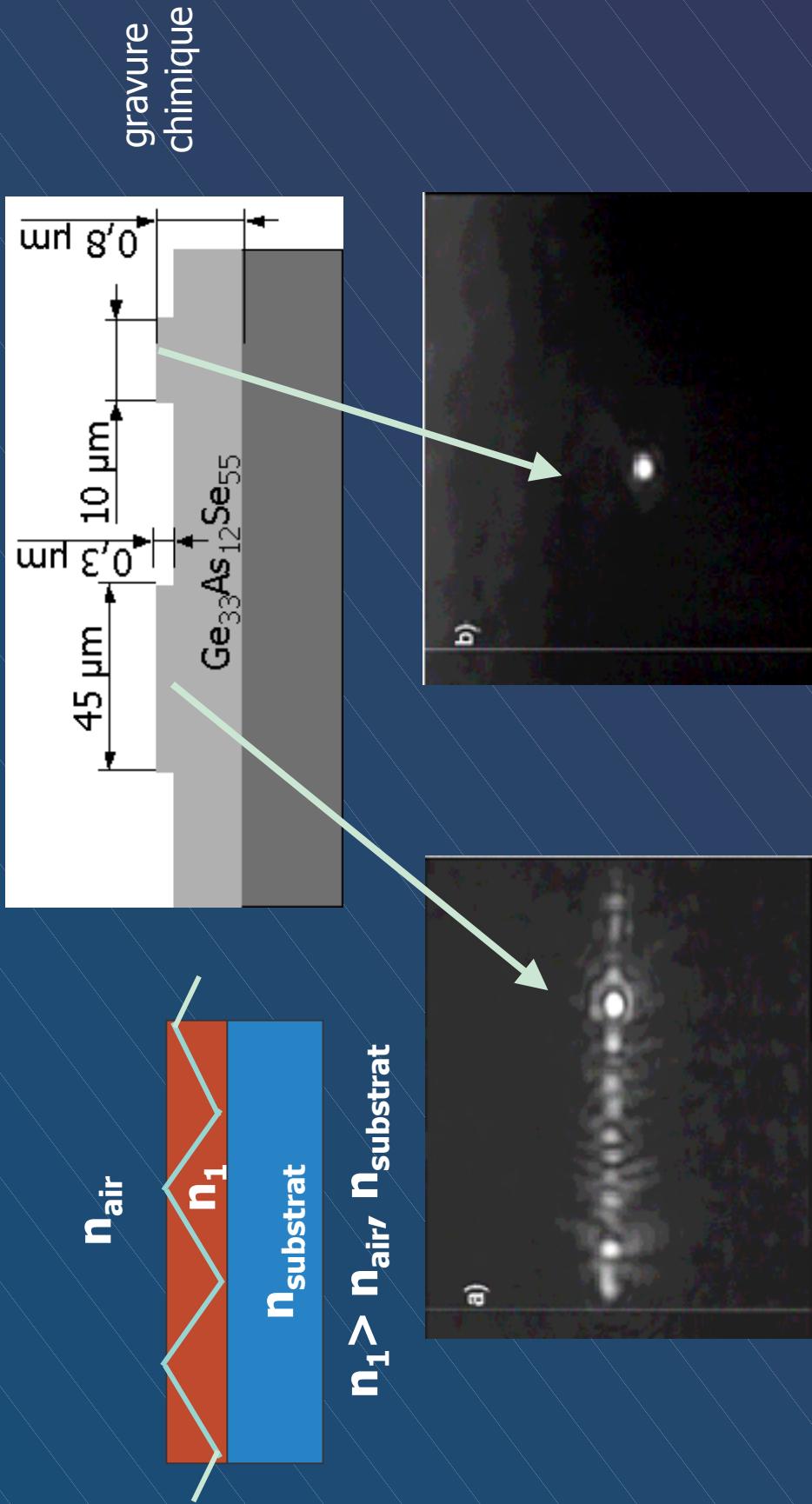
- Plasma CF<sub>4</sub>/O<sub>2</sub>

=> angle >70° /2,4 μm profondeur  
rugosité=56 nm



- Bonne sélectivité  
=>bonne résolution
- Difficile à mettre en œuvre

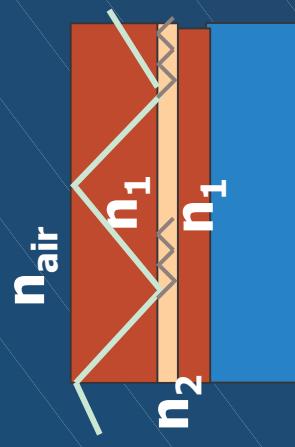
- Structures mono-couche, gravées  
(collaboration avec Adam Fuchs-IMEP)



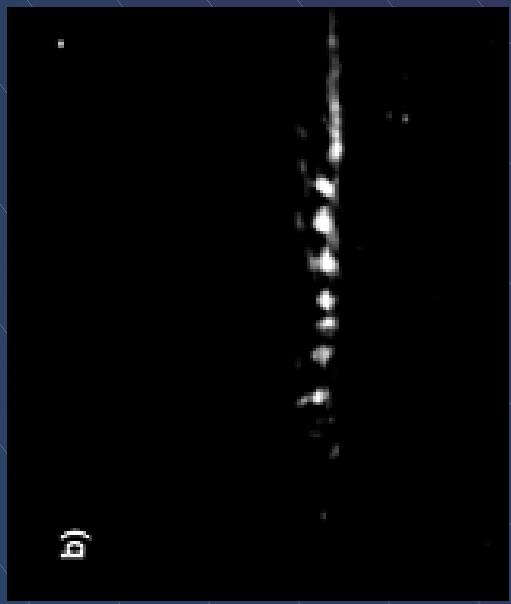
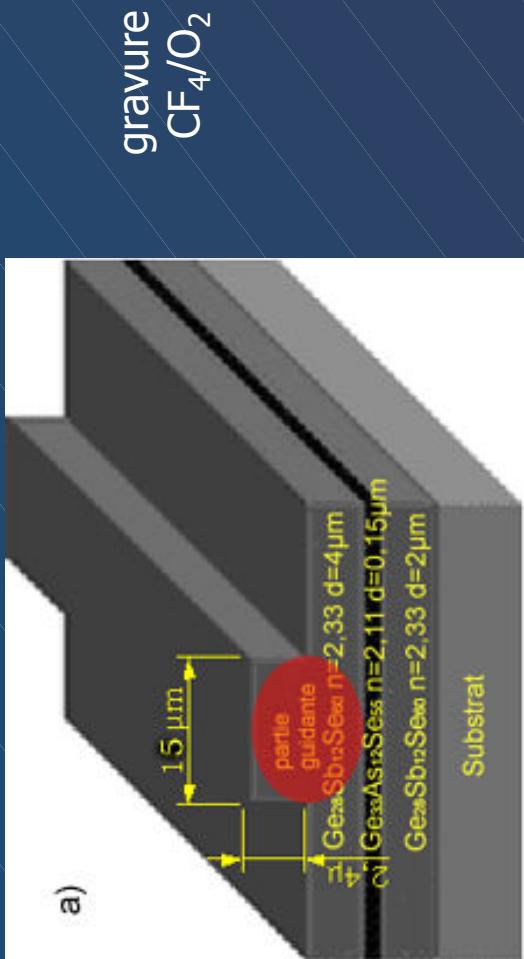
Confinement bidimensionnel

# Guides ARROW

## Collaboration avec CNM



$$n_1 > n_2, n_{\text{air}}$$

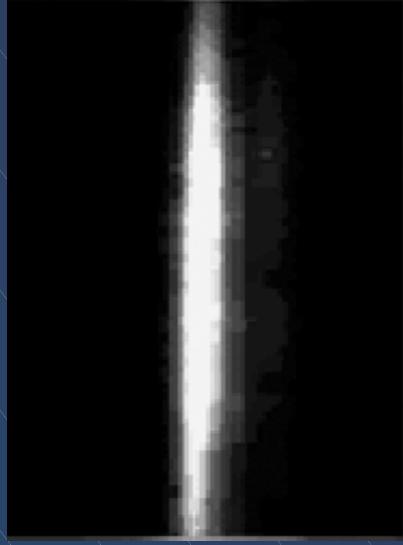
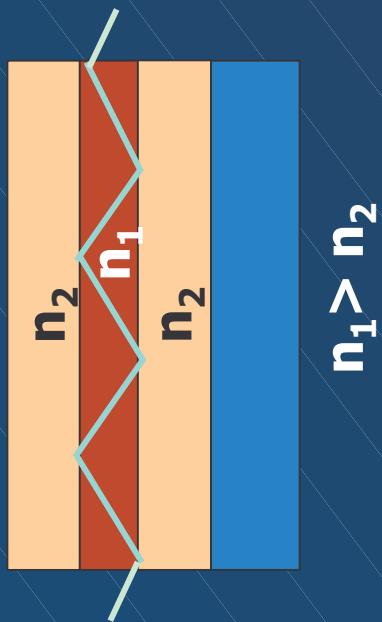
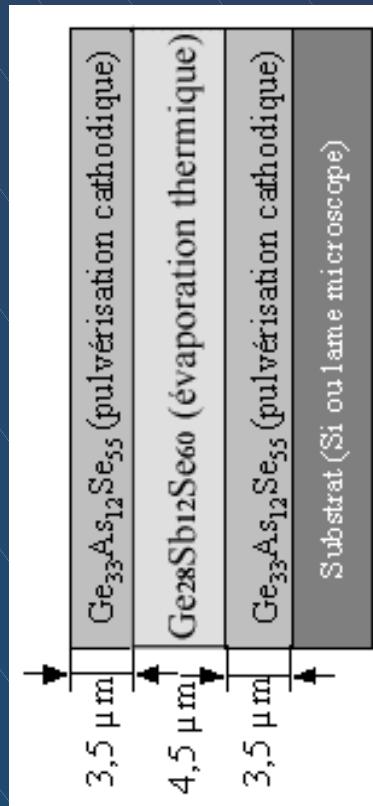


Microscopie optique

Confinement bidimensionnel

# Mesure de pertes optiques

- Structures 3 couches, non gravées



Pertes totales : 6 dB/cm

## **CONCLUSIONS & PERSPECTIVES**

**Objectif final : la réalisation de guides d'onde miniaturisés en verres chalcogénures pour des applications dans le domaine infrarouge**

- Deux types de structures guidantes réalisées par empilement et gravure des couches minces

#### Guide TIR:

- monomode
- pertes totales
- encourageantes

#### Guide ARROW:

- 1<sup>er</sup> guide ARROW
- chalcogénure
- multimode

Faisabilité démontrée  
Optimisation à effectuer

#### Obtention de couches plus denses :

- Porte-sousstrat chauffant
- Recuit
- Technique de dépôt plus énergétique

#### Amélioration des faces d'entrée :

- Meilleur clivage
- Polissage
- Substrat chalcogénure

- Dopage des couches minces  $\text{Ge}_{33}\text{As}_{12}\text{Se}_{55}$ ,  $\text{As}_2\text{S}_3$  par des ions erbium pour l'amplification optique

